光ファイバ長手方向波長分散分布測定法の改良

Improvement of a Measurement Method for the Longitudinal Chromatic Dispersion Distribution

> 忠隈昌輝^{*} 味村 裕^{*} 麻生 修^{*2} Masateru Tadakuma Yu Mimura Osamu Aso

概要 全光信号処理デバイスに必要となる高非線形光ファイバは、その仕様要求として長手方向に 安定した波長分散性を持つことが必要とされる。そのため、長手方向での波長分散分布特性を高精度 で評価する手段が必要となる。ファイバ中の四光波混合現象を用いる非線形OTDR法は波長分散分 布を測定する有効な方法であるが、非線形性の高いファイバを評価する際には、その特性ゆえの測定 誤差要因が存在していた。そのため、このようなファイバの波長分散分布特性を評価する際の測定誤 差要因を検討し、更なる高精度に向けた測定系の改良を行って、測定誤差の低減を実現しその有効性 を確認した。

1. はじめに

情報通信分野の自由化と情報社会の発展により、通信情報量 が飛躍的に増大する傾向にある。光を直接増幅するエルビウム ドープファイバ増幅器 (EDFA; erbium-doped fiber amplifier) やラマンファイバ増幅器 (raman fiber amplifier)の実用化に よって、波長1.55 µm帯では非常に高い強度の光信号が得られ るようになった。これによって光ファイバの伝送損失が補償さ れ,数千kmにも及ぶ無中継伝送が可能となっている。このよ うな光増幅技術を用いて、波長多重 (wavelength divi-sion multiplex; WDM) 通信方式や時分割多重 (time division multiplex; TDM) 通信方式により大容量化・高速化が進んでいる。光中継 システムの高速化が進むにつれ、光信号が光ファイバ中を伝播 する際に受ける波長分散,非線形効果,偏波モード分散などに よる信号波形劣化が顕著になる。このような信号劣化を補償 したり電気信号処理ではできない高速処理を行うデバイスとし て光ファイバの非線形性を用いたファイバ型デバイスが注目さ れている1)~3。非線形ファイバデバイスには通常のファイバ より10倍程度大きな非線形性を持つ高非線形ファイバが用い られる4,5。ファイバ中での非線形効果を利用する際、その非 線形性の大小とともに波長分散値の変化がその度合いに影響を 与える。そのためファイバ全長にわたって均一な波長分散値で あることが求められる。しかし光ファイバは母材の安定性や線 引時の変化など製造過程の不確定性により、長手方向に波長

分散特性の変動が生じてしまう。そのため光ファイバ長手方向 の波長分散値の分布状態を非破壊で評価する手段が求められて おり、様々な方法が検討されてきた。ファイバの両方向から OTDRにより後方散乱光波形を観測し、その平均値から構造 分散変化を求める方法6や非線形光学現象を利用した方法が提 案されている。現在多く用いられている方式は、ファイバ中の 四光波混合 (FWM; four wave mixing) により発生するアイド ラ後方散乱光を観測しその強度変動周期から分散を求める非線 形OTDR法フと呼ばれている測定方法である。そのほか変調不 安定性 (MI; modulation instability) の発生効率からゼロ分散波 長の分布を測定する方法8や光スペクトラムからゼロ分散波長 の分布を推定する方法9等が提案されている。これらの方法の 中から我々は非線形OTDR法を採用し、各種ファイバの評価 を行ってきた。しかし高非線形ファイバに対しては、精度の高 い測定値が求められることと、非線形性が高い特性から従来の ファイバとは異なり大きな測定誤差が生じる問題があった。本 報告では高非線形ファイバを測定する上での測定誤差の検討及 びその問題に対処した測定系の改良、高非線形ファイバ測定評 価結果を示す。

2. 非線形OTDR法の測定原理

非線形OTDR法の概念図を示す(図1)。

波長の異なる二波長のパルス光(ポンプ光とプローブ光)を ファイバに入射する。ファイバ中では四光波混合によりアイド ラ光が発生する。ファイバに入射した波長の異なるパルス光の 間には波長分散による遅延が生じるため、ファイバ長手方向の 各地点において互いの位相差が変化する。そのため発生するア

^{*} 研究開発本部 ファイテルフォトニクス研究所

^{*2} 研究開発本部 横浜研究所



図1 非線形OTDR法概念図 Schematic of nonlinear OTDR technique.

イドラ光の強度がその位相差に応じて変化する。そこでアイド ラ光の後方散乱光の時間的強度変動を観測し強度変化の周期を 見積もることにより波長分散を求めることができる。

非線形OTDR法において用いる理論的測定原理を,下記に 示す光ファイバ中での四光波混合現象を記述する非線形結合 モード方程式(1) ~ (3)式から検討してみる。

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{p}}}{\mathrm{d}z} + \frac{1}{2} \alpha E_{\mathrm{p}} = i\gamma \left| \left(\left| E_{\mathrm{p}} \right|^{2} + 2 \left| E_{\mathrm{s}} \right|^{2} + 2 \left| E_{\mathrm{c}} \right|^{2} \right) E_{\mathrm{p}} + 2 E_{\mathrm{p}}^{*} E_{\mathrm{s}} E_{\mathrm{c}} \exp\left(i\Delta\beta z\right) \right|$$
(1)

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{s}}}{\mathrm{d}z} + \frac{1}{2}\alpha E_{\mathrm{s}} = i\gamma \left| \left(\left| E_{\mathrm{s}} \right|^{2} + 2\left| E_{\mathrm{c}} \right|^{2} + 2\left| E_{\mathrm{p}} \right|^{2} \right) E_{\mathrm{s}} + E_{\mathrm{c}}^{*} E_{\mathrm{p}}^{2} \exp\left(-i\Delta\beta z \right) \right|$$
(2)

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{c}}}{\mathrm{d}z} + \frac{1}{2}\alpha E_{\mathrm{c}} = i\gamma \left| \left(\left| E_{\mathrm{c}} \right|^{2} + 2\left| E_{\mathrm{p}} \right|^{2} + 2\left| E_{\mathrm{s}} \right|^{2} \right) E_{\mathrm{c}} + E_{\mathrm{s}}^{*} E_{\mathrm{p}}^{2} \exp\left(-i\Delta\beta z \right) \right|$$
(3)

ここでp, s, cは各々ポンプ光, プローブ光, アイドラ光を 表す。 α は光ファイバの損失であり, γ は非線形定数 ($\gamma = 2\pi/\lambda_{\rm p} \cdot n_2/A_{\rm eff}, n_2$; 非線形屈折率, $A_{\rm eff}$: 有効コア断面積) である。 $\Delta\beta$ は伝搬定数の位相不整合条件zは長手方向を示す

$$\Delta \beta = \beta_{\rm s} + \beta_{\rm c} - 2\beta_{\rm p} \tag{4}$$

であり, 周波数的には位相整合条件

$$2\omega_{\rm p} = \omega_{\rm s} + \omega_{\rm c} \tag{5}$$

を満たしているものとする。ここで、 ω_{p} 、 ω_{s} 、 ω_{c} はそれぞ れポンプ光、プローブ光、アイドラ光の角周波数を示す。

非線形結合モード方程式((1)~(3)式)の厳密な解を求める のが困難なため、以下のような近似による解析解を用いて考察 している。

- 条件(1) FWM発生過程においては伝送損失が影響しない
- 条件(2) 自己位相変調(SPM)及び相互位相変調(XPM)の効 果は考慮しない

条件 (2) を満たすためには発生するアイドラ光強度が小さく ポンプ光とプローブ光の強度に影響を及ぼさないことが求めら れる。またこの時、入力ポンプ光強度 $P_p(z=0)$ と入力プロー ブ光強度 $P_s(z=0)$ は以下のような関係を保つことが必要であ る。

$$P_{\rm s}(z=0) = 2P_{\rm p}(z=0) \tag{6}$$

この(6)式の条件を保つことにより,SPMやXPMの効果を 打ち消し,上記条件(2)の仮定を成立させることになる。 ト記条件(1) (2)を考慮した式の道理は以下のようになる。

$$\frac{dz}{dz} = 0 \tag{(7)}$$

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{s}}}{\mathrm{d}z} = 0 \tag{8}$$

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{c}}}{\mathrm{d}z} = i \; E_{\mathrm{s}}^* E_{\mathrm{p}}^2 \exp\left(-i\Delta\beta z\right) \tag{9}$$

 E_{p} ; 波長 λ_{p} (ポンプ光) 電界, E_{s} ; 波長 λ_{s} (プローブ光) 電界 E_{c} ; アイドラ光電界, P_{p}^{0} ; 入力波長 λ_{p} 強度

 P_s^0 ;入力波長 λ_s 強度, $\Delta\lambda$;入力二波長間隔

これより長手方向 z の位置におけるアイドラ光の電界及び光強 度は以下のようになる。

$$E_{\rm c} = \frac{E_{\rm s}^* E_{\rm p}^2}{\Delta \beta} \left\{ 1 - \exp(-i\Delta\beta z) \right\}$$
(10)

$$P_{\rm c} = 4 \left(\frac{\gamma^2 P_{\rm s} P_{\rm p}}{\Delta \beta^2} \right) \sin^2 \left(\frac{\Delta \beta z}{2} \right) \tag{11}$$

ここでポンプ光, プローブ光及びアイドラ光の伝送損失を考慮 して, ファイバ距離zを伝搬し受光されるアイドラ後方散乱光 強度は以下の式で記される。

$$P_{\rm c}(z) \propto \left(\frac{\lambda_{\rm p}}{D_{\rm c} \Delta \lambda^2}\right)^2 \left(\frac{n_2 P_{\rm p}^0}{A_{\rm eff}}\right)^2 R P_{\rm s}^0 \sin^2(\Delta \beta z/2) \exp(-4\alpha z)$$
(12)

R: レーリー散乱係数, α: 損失係数, D: 波長分散値 ここで位相不整合条件Δβとポンプ光波長での波長分散値Dと の関係は次式で表される。

$$\Delta\beta = -\frac{\lambda_{\rm p}^2}{2\pi c} D(\lambda_{\rm p}) (\omega_{\rm c} - \omega_{\rm p})^2 = -\frac{\lambda_{\rm p}^2}{2\pi c} D(\lambda_{\rm p}) (\lambda_{\rm p} - \lambda_{\rm s})^2 \quad (13)$$

ここで $\lambda = 2\pi c / \omega$ の関係から(13)式は,

$$\Delta\beta = -2\pi c D \left(\lambda_{\rm p}\right) \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda_{\rm p}}\right)^2 \tag{14}$$

と表すことができる。 そして得られる波長分散値は (15) 式で示される。

$$D(\lambda_{\rm p}, z) = \frac{2n}{c^2} \left(\frac{\lambda_{\rm p}}{\Delta \lambda}\right)^2 f\left\{t = \left(\frac{2n}{c}\right)z\right\}$$
(15)

f(t):時間tにおけるアイドラ後方散乱光波形の瞬時周波数 このようにアイドラ後方散乱光の時間的変動波形(OTDR波 形)を観測し,その強度変動周期が波長分散値に比例している ことから,長手方向各地点での波長分散値を求めることができ ることになる。

3. 高非線形ファイバ測定時の問題点

非線形OTDR法を用いて光ファイバの波長分散分布をより 精度よく求めるには、アイドラ光のSN比が高く明瞭な時間的 変動波形を観測し正確な信号周波数を算出することが望まれ る。そのためにはより高いピーク強度を持つパルス光を入射す ることが必要となる。しかし高非線形ファイバを測定する際, 入射するパルスピーク強度を強くすると,その高い非線形性か ら以下に示す誤差要因が生じる問題がある。

3.1 誘導ブリユアン散乱 (SBS; Stimulated Brillouin Scattering) の発生

SBSは、あるしきい値以上の入力強度でファイバ中において 起こる非線形現象であり、入力光と異なる波長の後方散乱光が 誘導散乱してしまうため、全ての入力パワーが出力端まで透過 していかない。これはファイバ条長が長い場合や非線形性が高 いファイバでより発生する。この現象を回避するためには、位 相変調により光源スペクトル線幅を広げることが効果的である ことが知られているが入力パワーが高い場合には完全に抑える ことは難しい。また非線形OTDR法では入力ポンプ光及びプ ローブ光に強いピーク強度が必要になるため、光源であるLD からの光を光増幅器(EDFA)で増幅して使用することが一般 的である。この時EDFAで増幅されるポンプ光及びプローブ 光は被測定光ファイバの全長を往復する周期で繰り返すパルス でそのDuty比(パルス繰り返し時間間隔に対するパルス時間 幅の割合)は0.1~数%程度である。たとえは条長10 kmのファ イバに対しては、パルス繰り返し時間間隔が98 µs, パルス幅 が500 nsという値である。このようなDuty比が低く繰返し周 期の長いパルスをEDFAで増幅すると、パルスの先端部分が 急激に増幅されパルス形状が変形する (パルスサージが発生す る) 現象が起こる。これはエルビウム添加ファイバ中でパルス が透過しない間に励起光によりエルビウムイオンがエネルギー 上準位に励起され、次にパルスが透過する際に上準位から急激 なレーザ遷移が生じるためである。このようにパルスの先頭部 分だけが異常に強度が強い変形したパルスはファイバ伝播中に その先頭部分においてSBSを誘発してしまう。また非線形 OTDR法においてポンプ光とプローブの強度設定は、(6)式に 示したようにその強度比が1:2となるように設定している。し かし先端にサージが生じパルス幅の中でピーク強度が変化する パルスにおいては、パルス幅の全幅において強度比を2:1に設 定することは困難である。(6) 式が示すように強度比を2:1に 保つことで余計な非線形効果を相殺しているわけであるが、こ の条件が崩れると相殺されない非線形効果の影響で(12)式で 示した理論関係に誤差を生じる。また(12)式で示されるよう にファイバ長手方向の任意の地点zにおける後方散乱アイドラ 光強度はポンプ光及びプローブ光のパルス幅とピーク強度に比 例しているため、後方散乱アイドラ光の振動波形はパルス幅で 積算された効果として現れる。従って光増幅されながらもサー ジが抑えられパルスの全幅において強度が一様なすなわち矩形 のパルスが(6)式の条件を満たす最も望ましい形状であること が分かる。

3.2 変調不安定性 (MI; modulation instability) の影響

変調不安定性は信号光と周辺の波長の雑音との非線形な相互 作用によるもので,異常分散性ファイバ中で発生することが知 られている。特に高出力を得るためにEDFAを用いる際,信 号光とASEノイズとの相関で発生することが多い。非線形 OTDR法において波長の異なる二波長の強度設定は,(6)式に 示したようにその強度比が2:1となるように設定している。し かしファイバ中でMIが発生するとエネルギーが周辺の波長成 分として広がり、入力条件として強度比を2:1に設定しても、 出力端では二波長の光の強度比は2:1からかけ離れた状態とな る。このような状態では上記SBSにおける問題と同様に、相 殺されない非線形効果の影響で(12)式で示した理論関係に誤 差を生じる。MIはファイバ条長が長いほど発生するため、こ の影響がある場合には波長分散分布の測定結果はパルス入力側 から末端に進むにつれその測定精度が悪くなり誤差が大きく なっていく。

図2に非線形OTDR法において異常分散性ファイバ測定時 にMIが発生した状態での被測定光ファイバ入力及び透過スペ クトルを示す。入力スペクトルではポンプ光波長1553.4 nm, プローブ光波長1555.4 nmに対し,出力では中心波長は変わら ないものの入力光波長以外のスペクトル成分が発生している。 またこの時観測するアイドラ光は1551.4 nmに位置している が,MIが更に大きく発生すると観測するアイドラ光波長にお けるノイズレベルが上昇しついにはアイドラ光ピークがノイズ レベルに埋もれてしまい識別できない状態になってしまう。



図2 MI発生時の入力及び透過光スペクトル Optical input and transmission spectrum with MI.

MIはピーク強度に依存するため、その影響を抑えるために は強度を下げることが必要になる。しかし強度を下げると観測 するアイドラ光の発生も弱くSN比が悪くなることから測定誤 差が大きくなる。異常分散ファイバの波長分散分布を測定する 際のこのような問題は問題提起がされており、この問題を回避 する測定方法が提案されている¹⁰⁾。しかし、より複雑な測定系 構成が必要になり作業性が悪い難点がある。

4. 測定系の改良

上記した測定誤差要因を回避するための測定上のポイントを まとめると以下のようになる

- ・入力光強度の低減
- ・矩形パルスの実現
- ・アイドラ後方散乱光のSNRの向上
- これらの条件を同時に満たすための測定系の改良を行った。

4.1 入力光ノイズ低減によるアイドラ光 SNR 向上

従来の測定系構成では入力する2つの波長の光を合波・パル ス化し光増幅器で増幅後,被測定光ファイバに入射していた。 この構成では光増幅器で発生するASEノイズが混在してしま う。また入力光の波長設定は測定する光ファイバの平均波長分 散値に対応して調整するため光増幅器の出力直後に光フィルタ を挿入してASEノイズをカットすることも困難である。その ためパルス(ポンプ,プローブ)それぞれの光のノイズを低減 するため,各々の光を独立にパルス化,光増幅し,ASEノイ ズをカットする構成とした。

4.2 EDFAによるパルスサージを抑えるパルス整形

従来の測定では入力光は矩形波電気信号パルスが印加された 光変調器で矩形波パルス化され、光増幅器での増幅後サージが 発生していた。そこでパルスサージを抑制するため、EDFA 出力後の光パルス波形が矩形になるようにパルス化する光変調 器に印加する電気信号波形を調整した。図3に電気信号波形調 整によるパルスサージ補正の有無によるEDFA出力光パルス 波形を比較した。電気信号波形はファンクションジェネレータ により任意のパルス形状に生成され、EDFA出力光パルスの 形状を観測し矩形波となるように調整している。

測定系構成を図4に示す。

送信部で光ファイバに入力する二つの波長のパルス光(ポン





プ光とプローブ光)はそれぞれ独立して光増幅し狭帯域光バン ドパスフィルタでASEノイズをカットされる。これらのパル ス光は時間的に重なり合うように遅延時間を調整しカプラで合 波される。合波した光は被測定光ファイバに入力する。ファイ バ中では非線形効果によりアイドラ光が発生する。被測定光 ファイバが異常分散性ファイバである時ファイバ中でMIが発 生するが、ファイバへ入力するポンプ光及びプローブ光は光 フィルタでASEノイズが除去されポンプ光及びプローブ光の SN比が向上したことによりMIの発生効率を低減させることが できる。そのためアイドラ光波長においてもMIによるノイズ の増加を抑えることができ,観測する後方散乱アイドラ光の SN比を向上させることができる。

5. 高非線形ファイバ評価

表1に示す特性を持つ波長分散の正負が異なる二種類の高非 線形ファイバ (No.1, No.2) の測定を行った。測定条件を**表2**に 示す。入力光強度はプローブ光ピークにおいて20~30 mWと 従来の非線形OTDR法で用いられているピーク強度(約1 W) から大幅な強度低下を実現している。また異常分散性ファイバ 評価時にはファイバ透過光スペクトルから,「ポンプ光:プロー ブ光強度比が1:2」がほぼ保たれていることを確認した。二波 長間隔Δλはより広く設定した方が,アイドラ光強度振動周波 数が高くなり,距離的な測定精度は向上する。しかし (12) 式 で示されるようにアイドラ光強度はΔλの4乗に反比例して弱 くなる。したがって△λの設定限界は受光部での感度に依存し てくる。本測定系では、サーキュレータにより分岐された後方 散乱光を二つの狭帯域波長可変光バンドパスフィルタ(半値全 幅0.6 nm及び約3 GHz)を用いてアイドラ光を選択しAPD及 び電気増幅器で信号波形を検出・増幅しており微弱光観測が可 能である。そこで△λを末端まで強度変動波形が認識できる限 界に設定した。観測されたアイドラ後方散乱光波形を図5に、



図4 測定系構成図

BPF;光バンドパスフィルタ,ATT;光アッテネータ,PC;偏波コントローラ,APD;アベランジェフォトダイオード, FG;ファンクションジェネレータ

Experimental setup.

BPF; Optical band-pass filter, ATT; Optical attenuator, PC; Polarization controller, APD; Avalanche photodiode, FG; Function generator

波長分散分布測定結果を図6、図7及び表3に示す。測定はファ イバ両端(IN側, EX側)からパルスを入力し測定した結果を 比較している。IN側, EX側それぞれから測定した全長平均値 を比較すると,その差は0.01 ps/nm/km以下であった。また 位相法による全長平均波長分散値と比較すると,ファイバ No.1, No.2はそれぞれ0.8%,3.4%の差でありほぼ等しいこと が確認された。また各ファイバにおいてIN側, EX側からの測 定値を比較し,長手方向各地点での差を求め,局所ばらつきと して評価した。この時,局所ばらつきの最大値を求めると,ファ イバNo.1, No.2はそれぞれ0.046,0.027 ps/mn/kmであり,こ れは全長平均分散値の3.38,0.78%に対応し,長手方向の分布 としても誤差4%程度で測定されていると考えられる。

またこの測定系は高非線形ファイバだけでなく,非線形性の 低い通常の伝送路用光ファイバも同様の精度で測定できること を確認している。

表1	高非線形ファイバの特性
	Characteristics of selected fibers with high
	nonlinearity.

特性項目	No.1	No.2
分散 (ps · nm ⁻¹ · km ⁻¹) @1550nm	-1.431	3.506
分散スロープ (ps・nm ⁻² ・km ⁻¹) @1550 nm	0.021	0.021
カットオフ波長 $\lambda_{c}(nm)$	1141.1	1293.1
条長 (m)	7500	8000
$n_2/A_{\rm eff}$ (× 10 ⁻¹⁰ /W) @1550 nm	30	
損失 (dB/km) @1550 nm	0.386	0.419

表2 測定条件 Measurement conditions.

ファイバ	No.1	No.2			
ポンプ光波長 (nm)	1553.254	1553.250			
プローブ光波長 (nm)	1558.370	1557.084			
二波長間隔 (nm)	5.166	3.834			
プローブ光ピーク強度(mW)	20.5	31.2			
パルス幅 (ns)	300	300			

※ポンプ光強度はブローブ光強度の1/2に設定



図5 観測されたアイドラ後方散乱光波形 (No1.正常分散性ファイバでのIN 側入射時における例) Observed trace of idler back scattering light over the fiber length.



図6 波長分散分布特性 (No.1 正常分散性ファイバ) Chromatic dispersion distribution of No.1 fiber with normal dispersion.



図7 波長分散分布特性 (No.2 異常分散性ファイバ) Chromatic dispersion distribution of No.2 fiber with anomalous dispersion.

表3 長手方向波長分散分布測定結果 Measurement results of chromatic dispersion distribution of selected fiber.

()):(止。

(車位,ps・nm-1・km-1@1553.3 nm)							
ファイバ	No.1		No	o.2			
測定方向	IN	EX	IN	EX			
全長平均	-1.316	-1.317	3.411	3.420			
IN - EX 平均	-1.316		3.4	16			
標準偏差	0.052	0.053	0.211	0.212			
最大値	-1.250	-1.237	3.991	3.961			
最小值	-1.514	-1.506	3.197	3.208			
局所ばらつき 最大値	0.052 3.95%(対平均值)		0.1 2.55% (*	.00 対平均値)			
位相法測定值	-1.363		3.4	43			
位相法との誤差	0.046 (3.38%)		0.027 (0.78%)			

※位相法測定値はポンプ光波長換算値

1@1550.0

6. おわりに

全光信号処理に使用される高非線形ファイバは高い非線形特 性とともに波長分散値の安定性も求められており,測定精度の 高い波長分散分布測定方法で評価することが必要となる。そこ で送信パルス光のノイズ低減,矩形波パルス整形を行い,低入 力光強度で非線形ノイズを低減した非線形OTDR測定系を構 築し,高非線形ファイバの測定評価を行った。その結果,位相 法による全長平均分散値からの差及び長手方向各地点での局所 的誤差ともに全長分散値の4%程度の精度での測定が実現され た。

参考文献

- 1) O. Aso et al.: Electron. Lett., **36** (2000), 709.
- 2) F. Futami et al.: OAA2003, MD07 (2003), 82.
- 3) K. Igarashi et al.: OAA2003, CMH7 (2003).
- T. Okuno et al.: IEEE J. Selct. Top. Quantum Electron., 5 (1999), 1385.
- 5) J. Hiroishi et al.: ECOC2002, PD-1, 5 (2002).
- 6) K. Nakajima et al.: J. Lightwave Technol., 15 (1997), 1095.
- 7) L. F. Mollenauer, et al.: Opt. Lett. 21 (1996), 1724.
- 8) S. Nishi et al.: Electron. Lett., **32** (1996), 579.
- 9) I. Brener et al.: Opt. Lett., 23 (1998), 1520.
- 10) M. G. Herraez et al.: ECOC2003, PD Th4.1.5 (2003).